

### **III-grupės nitridų MOCVD inovatyvios epitaksių vystymas**

Bus vystoma nuotolinės epitaksių tematika, kuris leidžia per grafeno ar kitos medžiagos monosluoksnį MOCVD būdu auginti puslaidininkinius epitaksius sluoksnius. Užaugintas GaN yra silpnai susietas su padėklu todėl gali būti atskirtas, ir tokiu būdu suformuoja puslaidininkinė lanksti membrana. Tema aktualumas nulemtas to, kad šis naujas epitaksių būdas dar néra plačiai išvystytas ir įgalina naujus tų pačių medžiagų funkcionalumus. Doktorantūroje bus vystoma ši nauja epitaksių ir nukėlimo technologija, aiškinamasi nuotolinės epitaksių fiziniai mechanizmai. Užauginti sluoksniai bus visapusiskai charakterizuojami įvairiomis metodikomis XRD, SEM, AFM ir kitomis. Antrajame doktorantūros etape naudojant III-grupės nitridų membranų technologija bus vystoma naujų optoelektroninių prietaisų technologija. Taip pat bus tiriami inovatyvios epitaksių metodai panaudojant nestandardinius nitridams epitaksius padėklus ir tarpsluoksnius, kurie leis kontroliuoti III grupės nitridų poliškumą.

### **Development of innovative MOCVD epitaxy of III-nitrides**

The PhD topic is to investigate remote epitaxy, a novel technique facilitating the growth of semiconductor epitaxial layers atop monolayers of graphene or similar monolayer material via Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD). This method enables the detachment of as-grown GaN due to its weak bonding to the substrate, resulting in the formation of a semiconducting flexible membrane. The relevance of the topic is determined by the fact that this new epitaxial method has not yet been widely developed and enables new functionalities of the same materials. The research will elucidate the physical mechanisms underlying remote epitaxy. Comprehensive characterization of the grown layers will be conducted utilizing various techniques including X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM), and others. The subsequent phase of the doctoral research will focus on developing optoelectronic devices utilizing III-group nitride membrane technology. Innovative epitaxial methods utilizing non-traditional substrates and interlayers for nitrides will be explored to control the polarity of group III nitrides.